

Bergische Universität Wuppertal

FORTGESCHRITTENEN PRAKTIKUM

Strukturanalyse mit Röntgenstrahlung

Ver fasser:

Henrik JÜRGENS

Frederik STROTHMANN

Tutoren:

Stephan Balk

Abstract:

In diesem Versuch wird mittels Röntgenspektroskopie die Struktur verschiedener Materialien untersucht

Bereich	max. %	+/0/-	erreicht %
Einleitung & Theorie	15		
Durchführung			
Auswertung	70		
phys. Diskussion			
Zusammenfassung			
Formales	15		
Note			

Inhaltsverzeichnis

1	Ein	leitung	5	2
2	The	eorie		2
	2.1	Die B	raggsche Gleichung	2
	2.2	Chara	kteristische Röntgenstrahlung	3
	2.3	Röntg	enröhre	3
	2.4	Mono	chromatoren und Detektoren	4
3	Mes	ssung	des Emissionsspektrums von Kupfer und der Netzebenenabstände	<u>,</u>
	von	Si(33	1) und $Ge(111)$	5
	3.1	Versu	chsdurchführung	5
		3.1.1	Emissionsspektrum der Kupferanode	6
		3.1.2	Bestimmung der Netzebenenabstände von $Si(331)$ und $Ge(111)$	6
	3.2	Auswe	ertung	7
		3.2.1	Verhältnisse	9
		3.2.2	Abschwächung durch den Ni-Filter	11
		3.2.3	Netzebenabstand Si(331)	11
		3.2.4	Netzebenabstand Ge(111)	12
4	Pul	verdiff	raktometrie	12
	4.1	Versu	chsdurchführung	13
	4.2	Auswe	ertung	14
5	Fazi	it.		15

1 Einleitung

Festkörper bilden eine der Grundlagen der heutigen Technologie, vor allem der Computer, die aus der heutigen Zeit nicht mehr weg zu denken sind. Deshalb ist es wichtig Eigenschaften von Festkörpern und Methoden zur Untersuchung dieser zu kennen. In diesem Versuch werden mittels Röntgenstrahlen verschieden Eingenschaften kristalliner Festkörper untersucht. Es werden zerstörungsfreie Methoden zur Untersuchung verwendet. Röntgenstrahlung sind elektromagnetische Wellen mit einer Wellenlänge von 1 pm bis 250 pm.

2 Theorie

Es werden nun die wichtigsten Hintergründe, die für diesen Versuch wichtig sind erläutert.

2.1 Die Braggsche Gleichung

Die Braggsche Gleichung, welche eine Bedingung für konstruktive Interferenz bei der elastischen Streuung von Photonen an einem Kristallgitter liefert, wurde 1913 von H. Bragg und W. L. Bragg aufgestellt. Sie ist einfacher als die Beschreibung von Max von Laue, welcher die Beugung von Röntgenstrahlen an Kristallen unter schwächeren Voraussetzungen dargestellt hat. Aufgrund deren Äquivalenz wird meistens die Braggsche Gleichung bevorzugt. Die Folgende Graphik veranschaulicht den Strahlengang und erklärt die Braggsche Gleichung gleichzeitig:

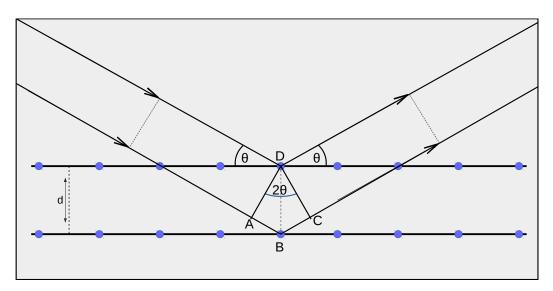


Abbildung 1: Braggsches Beugungsbild

Wie man unschwer an Abb. 1 abliest, ist die Bedingung für konstruktive Interferenz¹:

$$\lambda = 2d_{[nh,nk,nl]}\sin\Theta \tag{1}$$

¹Wobei die Ordnung des Reflexes üblicherweise in die Millerindizes eingeht

2.2 Charakteristische Röntgenstrahlung

Die charakteristische Röntgenstrahlung lässt sich mit dem Moesleyschem Gesetz beschreiben. Das Moesleysche Gesetz hängt nur von der Ordnungszahl des Materials und den Schalen des Übergangs ab, es beschreibt die Energie ausgesandter Photonen bei Übergängen von Elektronen. Das Moesleysche-Gesetz lautet:

$$f = f_R \cdot Z_{eff}^2 \cdot \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right) \tag{2}$$

 \mathbb{Z}_{eff} ist die effektive Kernlandung welche durch

$$Z_{eff} = Z - S \tag{3}$$

gegeben ist, wobei Z die Kernladung und S die Abschirmungskonstante ist. f_R die angepasste Rydberg-Frequenz, sie hängt von der Rydbergfrequenz (R) und der Kernmasse (Z) ab (Gl. 4).

$$f_R = R \frac{1}{1 + \frac{m_e}{Z}} \tag{4}$$

Mit dieser Gleichung und Gleichung 5 lässt sich nun die Energie der K_{α} und K_{β} Röntgenphotonen bestimmten, dabei wird für den K_{α} Übergang S mit 1 angenommen und für K_{β} S = 1,8 angenommen.

$$E = h \cdot f \tag{5}$$

2.3 Röntgenröhre

Für die Erzeugung von Röntgenstrahlung kann eine Röntgenröhre verwendet. Eine schematische Darstellung einer Röntgenröhre ist ein Abb. 2 zu sehen. Die Röntgenröhre besteht Hauptsächlich aus einer Glühwendel, einer Anode, und einer Vakuumglashülle. Die Glühwendel wird zum emittieren von Elektronen verwendet. Mit einer Potentialdifferenz von 10 bis 100 kV werden die Elektronen zur Anode hin beschleunigt. Die beschleunigten Elektronen treffen, auf die Anode, wo sie durch Stöße Röntgenstrahlen emittieren. Jedoch wird nur zu 1% Röntgenstrahlung erzeugt, der Rest geht in Wärme über, wodurch es nötig wird die Anode zu kühlen.

Heiz-Spannung Kathode Anodenspannung

Abbildung 2: Schematischer Aufbau einer Röntgenröhre

 $\sim 10 - 100 \text{ kV}$

2.4 Monochromatoren und Detektoren

Um die Funktionsweise von Detektoren und Monochromatoren zu verstehen, wird in diesem Abschnitt das Wichtigste besprochen. Die entscheidenden Eigenschaften von Detektoren sind:

1. Effizienz

Die Effizienz des Detektors soll also hoch im Bereich der zu untersuchenden Wellenlängen liegen und idealerweise ungewünschte Frequenzen filtern (Ineffizienz bei ungewünschten Wellenlängen).

2. Linearität

Bestenfalls ist das Detektorsignal direkt Proportional zur Lichtintensität

3. Energieproportionalität

Idealerweise direkte Proportionalität des Detektorsignals zur Energie des Einfallenden Lichtquants

4. Auflösung

Photonen verschiedener Wellenlänge/Energie sollten falls möglich ein unterscheidbares

Detektorsignal liefern. (Praktisch nicht realisierbar bei kontinuierlichem Spektrum)

Der Siliciumdriftdetektor (SDD) beispielsweise basiert auf einer pn-Diode bzw. einer Photodiode, welche in Sperrichtung geschaltet ist, was eine Verbreiterung der Raumladungszone bewirkt. Einfallende Röntgenstrahlung wird dort absorbiert und erzeugt Elektronen-Loch-Paare, welche aufgrund der hohen Spannung voneinader getrennt werden, sodass sie in der Raumladungszone nicht rekombinieren können. Dieses Konzept wurde lange Zeit weiterentwickelt, sodass heutige Siliciumdriftdetektoren komplizierter aufgebaut sind, um z.B. die Effizienz deutlich zu steigern. Dies ist auch das Problem der Silitiumdriftdetektoren, denn sie besitzen oberhalb von 10 KeV eine geringere Effizienz, sodass oberhalb dieser Grenze eine höhere Strahlungsintensität benötigt wird.

3 Messung des Emissionsspektrums von Kupfer und der Netzebenenabstände von Si(331) und Ge(111)

Im ersten Versuchsteil wird das Röntgenspektrum der Kupferanode mit einem Silicium(111)-Einkristall untersucht, für die Untersuchung werden drei verschieden Beschleunigungsspannungen und ein Ni-Filter verwendet. Untersucht werden die Zählraten in Abhängigkeit des Winkels, sowie die Lage aller Ordnungen der $K_{\alpha_{1,2}}$ - und K_{β} -Linien von Kupfer und deren Verhältnisse. Dann wird das Signal-Rausch-Verhältnis untersucht und weitere Details der Spektren besprochen. Im Anschluss werden die Netzebenabstände anderer Einkristalle untersucht. Untersucht werden Si(331)- und Ge(111)-Einkristalle. Die bestimmten Netzebenabstände werden mit Literaturwerten abgeglichen.

3.1 Versuchsdurchführung

Nach dem Braggschen Verfahren soll ein SI(111)-Einkristall untersucht werden. Genauer werden die Röntgenspektren für mindestens drei verschiedene Beschleunigungsspannungen aufgenommen. Zusätzlich wird ein Spektrum mit eingesetztem Ni-Filter bei einer hohen Röhrenspannung aufgenommen. Bei jeder Messung wird die Intensität als Funktion des Winkels bestimmt und die Lage aller Ordnungen der Braggreflexe der $K_{\alpha_{1,2}}$ - und K_{β} -Linien von Kupfer und deren Intensitätsverhältnisse zueinander. Aufgrund des Strukturfaktors für das Diamantgitter (Silitium und Germanium), wird der Braggreflex zweiter Ordnung unterdrückt. In der Messung des Emissionsspektrums mit Ni-Filter wird zusätzlich die Abschwächung der K_{β} -Linie und das "Signal zu Rausch" Verhältnis für die $K_{\alpha_{1,2}}$ Linien, deren resultierende Energie und Energiebreite bestimmt. Zuletzt sollen die Netzebenenabstände weiterer Einkristalle bestimmt werden, indem der Si(111)-Einkristall durch diese ersetzt wird und die Emissionsspektren aufgenommen werden. Die Resultate werden dann mit Literaturwerten für die Netzebenenabstände verglichen.

3.1.1 Emissionsspektrum der Kupferanode

Um das Emissionsspektrum der Kupferanode nach dem Braggschen Verfahren an einem Si(111)-Einkristall zu bestimmen, muss ein Literaturwert für den Netzebenenabstand vorausgesetzt werden. Der Netzebenenabstand beträgt 3.1356 Å (vgl. [?]). Damit können die Energien der charakteristischen Strahlung von Kupfer nach der Braggschen Gleichung und dem Zusammenhang zwischen Energie und Wellenlänge aus den Winkeln maximaler Reflexion bestimmt werden:

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{2d_{[nh,nk,nl]}sin\Theta} \tag{6}$$

d soll hierbei aufgrung des vernachlässigbaren Fehlers der Literaturangabe als fehlerlos angenommen werden. Der Fehler für die Energie berechnet sich also aus dem Fehler für den Winkel bei maximaler Reflexion:

$$\Delta E = \left| \frac{\partial E}{\partial \Theta} \Delta \Theta \right| = \left| \frac{E}{\tan \Theta} \Delta \Theta \right| \tag{7}$$

Die zugehörigen Counts können dann am Maximum der angefitteten Gausskurven abgelesen werden:

$$I = \frac{a}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \tag{8}$$

Die Parameter a und σ sowie deren Fehler werden aus dem Fit berechnet. Der Fehler von I ist dann:

$$\Delta I = \sqrt{\left(\frac{\Delta a}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right)^2 + \left(\frac{a\Delta\sigma}{\sqrt{2\pi\sigma^4}}\right)^2} \tag{9}$$

3.1.2 Bestimmung der Netzebenenabstände von Si(331) und Ge(111)

Um die Netzebenenabstände der Einkristalle Si(331) und Ge(111) zu bestimmen, werden diese in das Diffraktometer eingesetzt. Mit der Braggschen Gleichung werden nach der Aufnahme der Emissionsspektren die Netzebenenabstände bestimmt:

$$d = nd_{[nh,nk,nl]} = \frac{n\lambda}{2\sin\Theta} = \frac{nhc}{2E\sin\Theta}$$
 (10)

Für den Fehler ergibt sich also:

$$\Delta d = \sqrt{\left(\frac{\partial d}{\partial \Theta} \Delta \Theta\right)^2 + \left(\frac{\partial d}{\partial E} \Delta E\right)^2} = d\sqrt{\left(\frac{\Delta \Theta}{\tan \Theta}\right)^2 + \left(\frac{\Delta E}{E}\right)^2}$$
(11)

3.2 Auswertung

Es soll das Röntgenspektrum der Kupferanode bei drei unterschiedlichen Beschleunigungsspannungen und mit einem Ni-Filter, bei möglichst hoher Röntgenspannung untersucht werden. Zum beugen der Röntgenstrahlen wird ein Si(111)-Einkristall verwendet, der Netzebenabstand liegt bei 3.1356 Å, entnommen von [?]. Gescannt wird ein Winkelbereich von 15° bis 130°, dabei wurden für die Beschleunigungsspannung Werte von

- U = 30kV und A = 10mA
- U = 40kV und A = 10mA
- U = 40kV und A = 30mA

verwendet. Dabei ergeben sich die folgenden Plots.

In Abb. 3 ist das Diffraktogramm für U = 30kV und A = 10mA zu sehen.

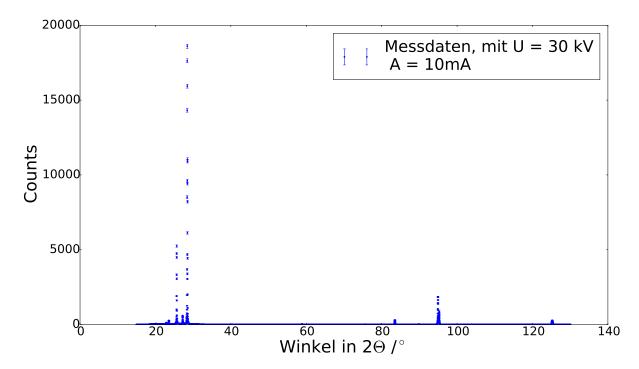


Abbildung 3: Diffraktogramm bei 30kV Beschleunigungsspannung und einem Anodenstrom von $10\mathrm{mA}$

In Abb. 4 ist das Diffraktogramm für U = 40kV und A = 10mA.

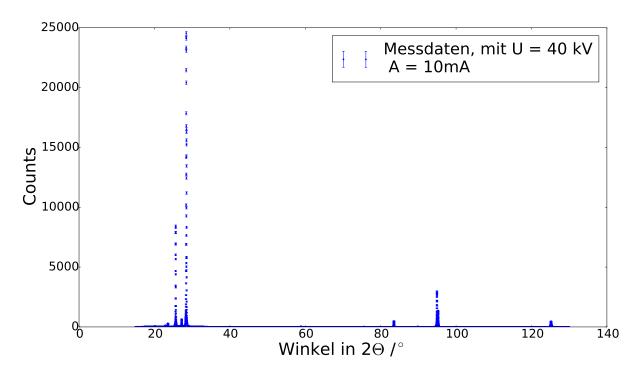
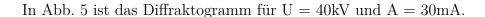


Abbildung 4: Diffraktogramm bei 40kV Beschleunigungsspannung und einem Anodenstrom von $10\mathrm{mA}$



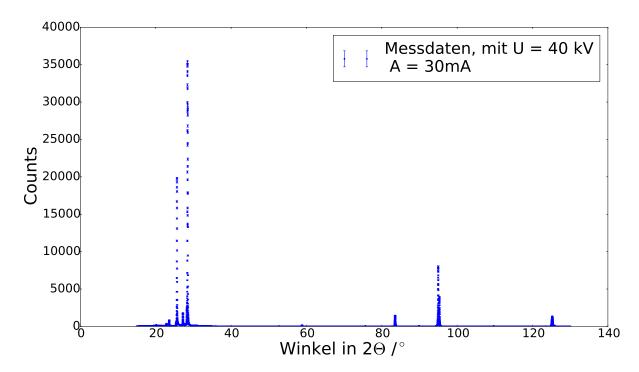


Abbildung 5: Diffraktogramm bei 40kV Beschleunigungsspannung und einem Anodenstrom von $30\mathrm{mA}$

Es ist deutlich zu erkennen, das bei steigender Beschleunigungsspannung und Strom die Anzahl der Counts größer werden und so die Peaks deutlich von dem Untergrund zu unterscheiden sind. Um Informationen über den Winkel und die Intensität zu erhalten, werden die Peaks mit der Voigtverteilung gefittet. Aus den Fitparametern kann die Intensität der einzelnen Peaks

bestimmt und verglichen werden. Der Fit für U=30kV und A=10mA ist in Abb. 6 zu sehen, die Fitparameter ergaben sich die Werte in Tabelle 1. Alle weiteren Peaks wurde nach dem selben verfahren bestimmt.

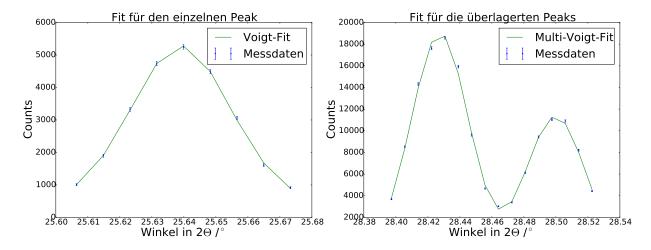


Abbildung 6: Diffraktogramm bei $40 \mathrm{kV}$ Beschleunigungsspannung und einem Anodenstrom von $30 \mathrm{mA}$

Tabelle 1: Fitparameter für eine Beschleunigungsspannung von $30\mathrm{kV}$ und einem Anodenstrom von $10\mathrm{mV}$

Peak	Paramter	Center	Amplitude	Sigma	Gamma	χ^2_{red}
1	Wert	$25,6390 \pm 0,0001$	260 ± 5	0.0124 ± 0.0007	$0,008 \pm 0,001$	1,08
2	Wert	$28,4278 \pm 0,0007$	790 ± 96	$0,0187 \pm 0,003$	$-0,003 \pm 0,006$	16,11
3	Wert	$28,4996 \pm 0,0007$	425 ± 128	0.021 ± 0.006	-0.01 ± 0.01	16,11

3.2.1 Verhältnisse

Aus den bestimmten Peaks sollen die Verhältnisse der Cu-Linien und der Ordnungen unter einander. Für den Voigt-Fit die eingebaute Funktion des Pythonpackages lmfit (cite) verwendet. Die Voigtverteilung wird über ein normiertes Intergral bestimmt, worduch der Fit Parameter für die Amplitude für die Verhältnisbestimmung verwendet werden. Die mit den Fits bestimmten Amplituden sind in Tabelle 2 zu sehen.

Tabelle 2: Bestimmte Winkel und Amplituden für die verschiedenen Beschleunigungsspannungen und Anodenströme

Beschleunigunsspannung und Anodenstrom	Ordnung	Linie	Winkel	Amplitude
U = 30 kV, A = 10 mA	1	K_{α_1}	$28,4278 \pm 0,0007$	790 ± 96
		K_{α_2}	$28,4996 \pm 0,0007$	425 ± 128
		K_{β}	$25,639 \pm 0,001$	260 ± 5
	3	K_{α_1}	$94,933 \pm 0,004$	155 ± 2
		K_{α_2}	$94,2453 \pm 0,0006$	76 ± 2
		K_{β}	$83,5022 \pm 0,0008$	37 ± 1
U = 40 kV, A = 10 mA	1	K_{α_1}	$28,4282 \pm 0,0003$	1149 ± 52
		K_{α_2}	$28,5008 \pm 0,0003$	654 ± 75
		K_{β}	$25,5400 \pm 0.0001$	425 ± 6
	3	K_{α_1}	$94,9336 \pm 0,0003$	245 ± 2
		K_{α_2}	$95,2448 \pm 0,0004$	122 ± 2
		K_{β}	$83,5043 \pm 0,0006$	57 ± 2
U = 40 kV, a = 30 mA	1	K_{α_1}	$28,433 \pm 0,001$	1046 ± 873
		K_{α_2}	$28,507 \pm 0,001$	1814 ± 613
		K_{β}	$25,6452 \pm 0,0001$	498 ± 158
	3	K_{α_1}	$94,9398 \pm 0,0002$	771 ± 6
		K_{α_2}	$95,2518 \pm 0,0003$	362 ± 4
		K_{β}	$83,5110 \pm 0,0004$	184 ± 4

Das Verhältnis wir nach Gl. 12 bestimmt, der Fehler ergibt sich dabei nach Gl. 13.

$$V = \frac{A_1}{A_2} \tag{12}$$

$$\Delta V = \sqrt{\left(\frac{\Delta A_1}{A_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta A_2 A_1}{A_2^2}\right)^2} \tag{13}$$

Aus den Amplituden in Tabelle 2 ergeben sich die Verhältnisse unter den Ordnungen in Tabelle 3. Die Verhältnisse bei unterschiedlichen Beschleunigungsspannungen und Anodenströmen sind in Tabelle 4 aufgetragen.

Tabelle 3: Verhältniss der Peaks bei unterschiedlicher Ordnung, dabei wird die Amplitude des Peaks erster Ordnung durch den der dritten geteilt

Anodenspannung und Anodenstrom	Linie	Verhältnis
U = 30 kV, A = 10 mA	K_{β}	$7,027 \pm 0,2$
	K_{α_1}	$5,1 \pm 0,6$
	K_{α_2}	6 ± 2
U = 40 kV, A = 10 mA	K_{β}	$7,4 \pm 0,3$
	K_{α_2}	$4,7 \pm 0,2$
	K_{α_2}	$5,4 \pm 0,6$
U = 40 kV, A = 30 mA	K_{β}	2.7 ± 0.8
	K_{α_2}	1 ± 1
	K_{α_2}	5 ± 2

Tabelle 4: Verhältniss der Peaks bei unterschiedlichen Beschleunigungsspannungen und Anodenströmen, dabei wird die Amplitude des Peaks erster Ordnung durch den der dritten geteilt

Beschleunigungs-	Ordnung	K_{eta}	K_{α_2}	K_{α_2}
spannung und				
Anodenstrom				
30 10 / 40 10	1	$0,61 \pm 0,01$	$0,69 \pm 0,09$	0.6 ± 0.2
	3	$0,650 \pm 0,003$	$0,63 \pm 0,01$	$0,62 \pm 0,02$
30 10 / 40 30	1	0.5 ± 0.2	0.8 ± 0.6	0.2 ± 0.1
	3	$0,201 \pm 0,007$	$0,218 \pm 0,003$	$0,210 \pm 0,006$
40 10 / 40 30	1	0.9 ± 0.3	$1,1 \pm 0,9$	0.36 ± 0.01
	3	0.31 ± 0.01	0.3446 ± 0.0004	0.337 ± 0.007

3.2.2 Abschwächung durch den Ni-Filter

Es soll die Abschwächung der K_{β} -Linie und das Signal-zu-Rausch Verhältniss der $K_{\alpha_{1,2}}$ -Linie und deren Energie und Energiebreite bestimmt werden. Mit Verwendung des Filters ergibt sich das Diffrakogramm in Abbildung ??.

Es ergibt sich eine Countrate von ?? mit Ni-Filter und ein Count von ?? ohne Ni-Filter. Daraus ergibt sich ein Verhältnis von ??. Das Signal-zu-Rauschverhältnis (SNR) wir in [dB] berechnet:

$$SNR = 10 \cdot lg \left(\frac{I_{max}}{I_{rausch}} \right) \tag{14}$$

3.2.3 Netzebenabstand Si(331)

Der Si(111)-Einkristall wird nun gegen einen Si(331)-Einkristall ausgetauscht. Mit den zuvor bestimmten Energien der Cu-Linien soll nach Gleichung ?? der Netzebenabstand bestimmt

werden, der Fehler wird mit Gleichung ?? berechnet. Die Peaks wurden wie zuvor mit der Gaußverteilung gefittet.

Aus den Messdaten ergeben sich die Werte in Tabelle??

Tabelle 5: In der Tabelle sind die Ergebnisse zur Bestimmung des Netzebenabstandes von Si(331)

Werte	K_{α_1}	K_{α_2}
$2\theta[^{\circ}]$		
$\Delta 2\theta$ [°]		
E[eV]		
$\Delta E[eV]$		
d[Å]		
$\Delta d[Å]$		

3.2.4 Netzebenabstand Ge(111)

Es soll ein Ge(111)-Einkristall untersucht werden, dabei wird wie zuvor vorgegangen.

Aus den Messdaten ergeben sich die Werte in Tabelle??

Tabelle 6: In der Tabelle sind die Ergebnisse zur Bestimmung des Netzebenabstandes von Ge(111)

Werte	K_{α_1}	K_{α_2}
$2\theta[^{\circ}]$		
$\Delta 2\theta$ [°]		
E[eV]		
$\Delta E[eV]$		
d[Å]		
$\Delta d[Å]$		

4 Pulverdiffraktometrie

Nun soll mit der zuvor verwendeten Methode die Zusammensetzung unbekannter Pulverproben bestimmt werden. Aus den bestimmten Diffraktogrammen soll mittels einer Datenbank die Zusammensetzung bestimmt, so wie die Netzebenabstände berechnet werden. Graphisch soll auch die Verträglichkeit der gefundenen Kristallstruktur mit dem Diffraktogramm gezeigt werden und die mittlere Kristallgröße ermittelt werden.

4.1 Versuchsdurchführung

Um die Zusammensetzung einer unbekannten Pulverprobe zu bestimmen, werden mit dem Diffraktometer Diffraktogramme erstellt, aus denen mittels einer Datenbank qualitativ die Probenzusammensetzung ermittelt werden kann. Ebenfalls sollen unabhängig von der Auswertung mithilfe der Datenbank einige Netzebenenabstände d aus den Diffraktogrammen manuell bestimmt werden. Dies geschieht nach der Braggschen Gleichung analog zum Versuchsteil 2.1.3 Formel ??. Nachdem graphisch gezeigt wurde, dass die gefundene Kristallstruktur mit den Diffraktogrammen verträglich ist, soll aus den Daten eine Abschätzung für die mittlere Kristallitgröße gemacht werden, welche aus der Scherrergleichung bestimmt werden kann.

$$\delta(2\Theta)_{Korn} = \frac{K\lambda}{Bcos\Theta_0} \tag{15}$$

Dabei ist $\delta(2\Theta)$ die volle Halbwertsbreite (FWHM) des Reflexes im Bogenmaß, Θ_0 das Maximum des Reflexes, K der Scherrer Formfaktor mit $K \approx 0.89$ und B die gesuchte Korngröße. Es ergibt sich also Für die Korngröße B, wenn man beachtet, dass $\delta(2\Theta)_{Korn} = \delta(2\Theta)_{Pulver} - \delta(2\Theta)_{Einkristall} :=$ und $E = \frac{hc}{\lambda}$ gilt:

$$B = \frac{0.89hc}{(\delta(2\Theta)_{Pulver} - \delta(2\Theta)_{Einkristall})Ecos\Theta_0}$$
(16)

Es ergibt sich ein Fehler von:

$$\Delta B = B \sqrt{\left(\frac{\Delta(\delta(2\Theta)_{Pulver} - \delta(2\Theta)_{Einkristall})}{\delta(2\Theta)_{Pulver} - \delta(2\Theta)_{Einkristall}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta E}{E}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\Theta_0}{\cot\Theta_0}\right)^2}$$
(17)

4.2 Auswertung

Bei der Analyse des vorgegebenen Pulvers mittels Debye Scherrer Verfahren ergab sich das Diffraktogramm in Abb. ??. Zum Vergleich sind Diffraktogramme von Silicium und Germanium (Abb. ??) simuliert worden. Man sieht sofort, dass das Diffraktogramm von Silicium mit dem der untersuchten Probe sehr gut Ìbereinstimmt. Daneben stellt man einen Offset der simulierten Daten zu den gemessenen fest. Um diesen Offset zu bestimmen, wurde an alle drei DatensÀtze ein Multivoigt gefittet. Die Voigtverteilung wird dabei numerisch approximiert, wobei die in Python bereits implementierte Voigt-Verteilung aus der Bibliothek "Imfit" verwendet wird.

5 Fazit